

Dispositivo Di Spurgo Con Gas Inerte In Pfa Ad Alta Purezza Per Analisi Di Tracce Di Precursori Semiconduttori - Sistema Di Spurgo Compatibile Con Azoto E Argon

Numero articolo: PL-CP429



introduzione

Dispositivo di spurgo con gas inerte in PFA ad altissima purezza per il rilevamento e l'analisi di tracce di precursori semiconduttori. Progettato per lo spurgo con azoto o argon, previene l'ossidazione e la contaminazione dei campioni nei flussi di lavoro di laboratorio critici. Costruzione durevole e resistente agli agenti chimici per la ricerca professionale.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Test di precursori per semiconduttori	Spurgo di precursori organometallici con argon per prevenire l'ossidazione prima dell'analisi ICP-MS.	Garantisce una caratterizzazione accurata dei precursori ALD/CVD.
Controllo qualità per fabbricazione di CI	Spurgo con gas ad alta purezza per l'analisi di metalli in traccia nei prodotti chimici di processo.	Abbassa il limite di rilevazione eliminando la contaminazione proveniente dal materiale.
Ricerca su elettroliti per batterie	Protezione dei componenti di batterie al litio sensibili all'umidità durante l'estrazione con solvente e lo spurgo.	Mantiene la stabilità dell'elettrolita per test elettrochimici consistenti.
Sintesi di catalizzatori	Gestione di catalizzatori sensibili all'aria durante la transizione dalla sintesi all'analisi.	Previene l'avvelenamento del catalizzatore da parte dell'ossigeno o dell'umidità atmosferica.
Analisi di tracce petrolchimiche	Rimozione di frazioni volatili da matrici idrocarburiche complesse mediante spostamento con azoto.	Eccellente resistenza ai composti e ai solventi aggressivi contenenti zolfo.
Preparazione di nanomateriali avanzati	Mantenimento di un ambiente inerte durante la preparazione del campione di nanoparticelle funzionalizzate.	Preserva la chimica superficiale e previene l'ossidazione superficiale non desiderata.
Analisi di gas speciali	Funge da interfaccia ad alta purezza per il campionamento e l'analisi di gas elettronici ad alta purezza.	Previene il rumore di fondo da perdite atmosferiche o degassamento del materiale.

Caratteristica	Dettagli delle specifiche (PL-CP429)
Materiale principale	PFA (Perfluoroalcoxi) ad altissima purezza
Processo di produzione	Lavorazione CNC di precisione / Fabbricazione su misura
Capacità standard	30ml (Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta)
Compatibilità con gas	Azoto (N ₂), Argon (Ar), Elio (He) e altri gas inerti
Resistenza chimica	Resistenza a tutti i solventi comuni, acidi forti e basi
Intervallo di temperatura	Completamente personalizzabile in base alle specifiche esigenze di temperatura dell'applicazione
Valutazione della pressione	Progetto ottimizzato per pressioni di spurgo gas standard (personalizzabile)
Porte di connessione	Adattate per adattarsi alle linee di gas esistenti e alle interfacce di strumenti analitici

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Caratteristica	Dettagli delle specifiche (PL-CP429)	
Protocollo di pulizia	Compatibile con procedure di lavaggio acido e pulizia ad alta purezza	